

Journées de formation : Techniques associées à la microscopie électronique à balayage

Louvain-La-Neuve, les 27, 28 et 29 mars 2012

Bâtiment Carnoy (B0)

**Place Croix du Sud, 4, 1348 Louvain-La-Neuve
(accès – Avenue Théodore Schwann - parkings 11 & 12)**

27 mars:

Microanalyse quantitative (EDS-WDS)

Invité : Jacky RUSTE (GN-MEBA)

- résultats du round-robin (analyses croisées sur échantillon témoin)
- principes de l'analyse élémentaire quantitative
- travaux pratiques (SEM-EDS)

28 mars :

Diffraction d'électrons rétrodiffusés (EBSD)

Invité : François BRISSET (Univ.Paris Sud)

- principes et applications de l'EBSD
- travaux pratiques (SEM-EBSD)

Nanolithography

Invited : Stefan STRAEHLE (Xenos Semiconductor Technology)

- principes of nanolithography
- démonstration (SEM-nanolithography)

29 mars :

Techniques avancées de préparation des matériaux biologiques, polymères et composites

Invités : Jean-Pierre LECHAIRE (Université Paris VI – Jussieu)

Alain JADIN (Certech)

28 et 29 mars :

- ***Exposition et démonstration d'équipements de préparation, de conditionnement et d'observation : faisceau ionique, ultramicrotomie, cryotransfert, platines froides, STEM...***
- ***Poster session***

Journées de formation : Techniques associées à la microscopie électronique à balayage

27, 28 et 29 mars 2012

FORMULAIRE D'INSCRIPTION – Sociétés/Industries

L'inscription donne priorité pour l'accès aux travaux pratiques (nombre de places limité).
Merci de nous retourner ce formulaire complété avant le **30 novembre 2011**

- Par e-mail : aurore.becquevort@uclouvain.be

- Par fax au : +32(0)10.45.15.93

- Par courrier : U.C.L. – IMCN/BSMA, Croix du Sud,1, bte. L7.04.02. 1348 Louvain-La-Neuve (Belgique)

(Veuillez écrire en caractères d'imprimerie)

Nom, prénom :

Institution

Service

Adresse :

Code Postal: Localité

Téléphone : Téléfax:

E-mail : N° TVA :

PARTICIPATION AUX THEMATIQUES

- 27 mars

- Microanalyse quantitative séminaire trav. Pratique Niveau(*) :.....
- Participation au Round Robin Envoi d'un échantillon

- 28 mars

- EBSD séminaire trav. Pratique Niveau(*) :.....

OU

- Nanolithography séminaire démonstration

- 29 mars

- Techniques de préparation séminaire démonstration

(*) : pour la bonne préparation des travaux pratiques, veuillez indiquer votre niveau de maîtrise de la technique :
NOVICE ou AVANCE

Frais de participation : 70 euros (+ 30 euros pour la participation au Round Robin).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Aurore Becquevort au +32(0)10.47.35.60.

Signature du participant

Nom et signature du responsable

**Journées de formation : Techniques associées à la microscopie
électronique à balayage**

27, 28 et 29 mars 2012

FORMULAIRE D'INSCRIPTION – Universités/Hautes Ecoles

L'inscription donne priorité pour l'accès aux travaux pratiques (nombre de places limité).
Merci de nous retourner ce formulaire complété avant le **30 novembre 2011**

- Par e-mail : aurore.becquevort@uclouvain.be

- Par fax au : +32(0)10.45.15.93

- Par courrier : U.C.L. – IMCN/BSMA, Croix du Sud,1, bte. L7.04.02. 1348 Louvain-La-Neuve (Belgique)

(Veuillez écrire en caractères d'imprimerie)

Nom, prénom :

Société

Service

Adresse :

Code Postal: Localité

Téléphone : Téléfax:

E-mail : N° TVA :

PARTICIPATION AUX THEMATIQUES

- **27 mars**

- Microanalyse quantitative séminaire trav. Pratique Niveau(*) :
- Participation au Round Robin Envoi d'un échantillon

- **28 mars**

- EBSD séminaire trav. Pratique Niveau(*) :

OU

- Nanolithography séminaire démonstration

- **29 mars**

- Techniques de préparation séminaire démonstration

(*) : pour la bonne préparation des travaux pratiques, veuillez indiquer votre niveau de maîtrise de la technique : NOVICE ou AVANCE

Frais de participation : Universités, Hautes Ecoles : GRATUIT

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Aurore Becquevort au +32(0)10.47.35.60.

Signature du participant

Nom et signature du responsable

Journées de formation : Techniques associées à la microscopie électronique à balayage

27, 28 et 29 mars 2012

Formulaire d'inscription – Engagement de votre société

Contrat pour les **EXPOSANTS** (Veuillez écrire en caractères d'imprimerie)

Nom de l'entreprise + Service :

Adresse :

Code Postal : Localité

Téléphone : Fax :

E-mail : N° DE TVA :

Nom + prénom (personne de contact)

Sujet de votre présentation :

.....
.....

(Veuillez joindre un résumé de votre présentation)

PARTICIPATION AUX THEMATIQUES (Attention : nombre de places limité).

- **27 mars**

- *Microanalyse quantitative* séminaire trav. Pratique Niveau(*) :.....
- Participation au *Round Robin* Envoi d'un échantillon

- **28 mars**

- *EBS* séminaire trav. Pratique Niveau(*) :.....

OU

- *Nanolithography* séminaire démonstration

- **29 mars**

- *Techniques de préparation* séminaire démonstration

(*) : pour la bonne préparation des travaux pratiques, veuillez indiquer votre niveau de maîtrise de la technique : NOVICE ou AVANCE

Frais de participation pour les EXPOSANTS: 500 euros.

Une facture vous sera adressée après réception de votre inscription.

Veillez remplir ce formulaire d'inscription et le renvoyer dûment complété et signé à l'adresse suivante pour le **30 NOVEMBRE 2011.**

- Par e-mail : aurore.becquevort@uclouvain.be

- Par fax au : +32(0)10.45.15.93

- Par courrier : U.C.L. – IMCN/BSMA, Croix du Sud, 1, bte.L7.04.02., BE-1348 Louvain-La-Neuve

Fait à, le

Pour accord,

Signature du participant

Nom et signature du responsable

Pour toute question relative au présent document, vous pouvez contacter notre secrétariat au +32(0)10.47.35.60
